



**Avviso esito sui risultati della procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera di  
“RF/DC sputtering per la deposizione di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali  
isolanti mediante tecnologia Physical Vapor Deposition (PVD)”**

- 1) Amministrazione aggiudicatrice:  
Università di Pisa  
Lungarno Pacinotti 43  
56126 Pisa
- 2) Tipo di procedura prescelta:  
Procedura negoziata, art.36 comma 2 lett. b) D.lgs.n.50/2016, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- 3) Numero di Operatori economici che hanno manifestato interesse:  
Nr. 2  
2M STRUMENTI SRL , con sede in Roma 00141, via G. Pontano n. 9.  
MITEC SRL con sede in Roma, viale Liegi n. 42.
- 4) Numero di operatori invitati:  
Nr.2  
2M STRUMENTI SRL , con sede in Roma 00141, via G. Pontano n. 9.  
MITEC SRL con sede in Roma, viale Liegi n. 42.
- 5) Numero di offerte pervenute:  
Nr.1
- 6) Numero di offerte ammesse:  
Nr.1
- 7) Date verbali delle sedute:  
Seggio di gara: 23.07.2018  
Seggio di gara/Commissione giudicatrice: 27.07.2018
- 8) Delibera di aggiudicazione efficace:  
29.08.2018
- 9) Aggiudicatario:  
**2M Strumenti s.r.l.**  
**Via G. Pontano, 9**  
**00141 ROMA**
- 10) Data avvenuta stipula del contratto: 30.08.2018

Pisa lì,

Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica  
-Dott.ssa Elena Perini-  
(firmato digitalmente)